

CF-E16 低損傷磊晶蝕刻機 (Samco 200ip Etcher)

製程能力



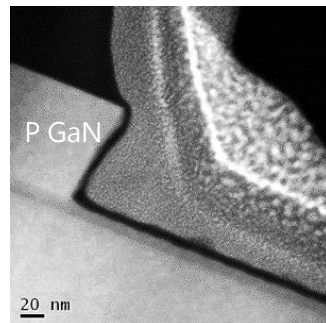
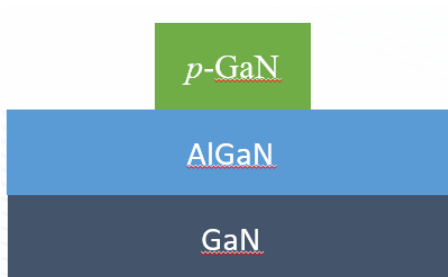
□ 製程能力

- P GaN Etching (厚度 < 100nm)
- AlGaN Etching (厚度 < 30nm)

□ 晶片尺寸

- 破片 (至少 1cm x 1cm 以上)
- 4吋、6吋、8吋晶圓

P GaN etching



AlGaN etching

